

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-230624

(43)公開日 平成5年(1993)9月7日

(51)Int.Cl.⁵
C 2 3 C 14/22

識別記号
7308-4K

府内整理番号
F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 3(全 5 頁)

| | | | |
|----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| (21)出願番号 | 特願平4-33418 | (71)出願人 | 000005223 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 |
| (22)出願日 | 平成4年(1992)2月20日 | (72)発明者 | 島尻 学 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 |
| | | (72)発明者 | 橋口 敏文 鹿児島県薩摩郡入来町副田5950番地 株式 会社九州富士通エレクトロニクス内 |
| | | (72)発明者 | 井上 実 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 青木 朗 (外3名) |
| | | | 最終頁に続く |

(54)【発明の名称】 PVD装置の内部治具発塵防止方法及び内部治具処理装置